



(10) 国際公開番号
WO 03/105218 A1

- [続葉有]

〔続葉有〕

WO 03/105218 A1



手 続 補 正 書

(法第11条の規定による補正)

特許庁審査官 中島 昭浩 殿

1. 国際出願の表示 P C T / J P O 3 / 0 6 5 4 2

2. 出 願 人

名 称 東京エレクトロン株式会社 TOKYO ELECTRON LIMITED

あて名 〒107-8481 日本国東京都港区赤坂五丁目3番6号

3-6, Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8481 Japan

国 籍 日本国 Japan

住 所 日本国 Japan

3. 代 理 人

氏 名 (7581)弁理士 吉武 賢次

YOSHITAKE Kenji

あて名 〒100-0005 日本国東京都千代田区丸の内三丁目2番3号

富士ビル323号 協和特許法律事務所

Kyowa Patent & Law Office, Room 323, Fuji Bldg.,

2-3, Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-Ku,

TOKYO 100-0005 Japan

4. 補正の対象 請求の範囲

5. 補正の内容

1) 請求の範囲第1項を削除する。

2) 請求の範囲第2項を補正前の請求の範囲第2項が規定する内容と同一内容の独立項に補正する。

3) 請求の範囲第3項4行目の「請求項1または2」を「請求項2」と補正する。

- 4) 請求の範囲第5項4行目の「請求項1または2」を「請求項2」と補正する。
- 5) 請求の範囲第7項4行目「請求項1乃至6」を「請求項2乃至6」と補正する。
- 6) 請求の範囲第8項を補正前の請求の範囲第8項が規定する内容と同一内容の独立項に補正する。
- 7) 請求の範囲第10項を削除する。
- 8) 請求の範囲第11項を削除する。
- 9) 請求の範囲第12項1行目「請求項1乃至11の・・・容器体搬送エリアと、」を「請求項2乃至9の・・・容器体搬送エリアと、」と補正する。

6. 添付書類の目録

請求の範囲第18頁、第19頁、
第19／1頁、第20頁

請求の範囲

1. (削除)

2. (補正後) 複数枚の第1被処理体を保持できる開放型のカセットを収容できると共に、前記第1被処理体よりも大口径の複数枚の第2被処理体を収納できる大きさを有するボックス容器と、

前記ボックス容器の内側壁に設けられ、前記複数枚の第2被処理体を多段に支持する支持部と、

前記ボックス容器の開口部に着脱可能に設けられた開閉蓋と、

前記ボックス容器の底部に着脱可能に設けられた位置決め係合部と、
を備え、

前記開閉蓋は、前記ボックス容器を密閉可能となっており、

前記位置決め係合部は、前記カセットの底部下面に設けられた位置決め部材と係合して、当該カセットの位置決めを行うことが可能であり、

前記第1被処理体を収納する前記カセットが前記ボックス容器内に収容された時の当該第1被処理体の前記開口部側の周縁端の位置が、前記第2被処理体が前記ボックス容器内に収容された時の当該第2被処理体の前記開口部側の周縁端の位置と、略一致するようになっている
ことを特徴とする被処理体の収納容器体。

3. (補正後) 前記開閉蓋の内側に、前記第1被処理体を収容する前記カセットが前記ボックス容器内に収容された時、当該カセットから当該第1被処理体が飛び出すことを防止するための第1飛び出し防止部材が設けられている
ことを特徴とする請求項2に記載の収納容器体。

4. 前記第1飛び出し防止部材は、前記開閉蓋に対して着脱可能であることを特徴とする請求項3に記載の収納容器体。

5. (補正後) 前記開閉蓋の内側に、前記第2被処理体が前記ボックス容器内に收容された時、当該ボックス容器から当該第2被処理体が飛び出すことを防止するための第2飛び出し防止部材が設けられていることを特徴とする請求項2に記載の収納容器体。

6. 前記第2飛び出し防止部材は、前記開閉蓋に対して着脱可能であることを特徴とする請求項5に記載の収納容器体。

7. (補正後) 前記ボックス容器内の底部には、カセットベース台が着脱可能に收容されており、

前記位置決め係合部は、前記カセットベース台の上面に設けられていることを特徴とする請求項2乃至6のいずれかに記載の収納容器体。

8. (補正後) 複数枚の第1被処理体を保持できる開放型のカセットを收容できると共に、前記第1被処理体よりも大口径の複数枚の第2被処理体を収納できる大きさを有するボックス容器と、

前記ボックス容器の内側壁に設けられ、前記複数枚の第2被処理体を多段に支持する支持部と、

前記ボックス容器の開口部に着脱可能に設けられた開閉蓋と、

前記ボックス容器の底部に着脱可能に設けられた位置決め係合部と、
を備え、

前記開閉蓋は、前記ボックス容器を密閉可能となっており、

前記位置決め係合部は、前記カセットの底部下面に設けられた位置決め部材と係合して、当該カセットの位置決めを行うことが可能であり、

前記ボックス容器内の底部には、カセットベース台が着脱可能に收容されており、

前記位置決め係合部は、前記カセットベース台の上面に設けられており、

前記カセットベース台の周縁部には、当該周縁部から出脱可能に設けられた台固定ジグが設けられており、

前記台固定ジグが前記ボックス容器の内側壁に押圧接触されることによって、前記カセットベース台が前記ボックス容器内に固定されるようになっていることを特徴とする収納容器体。

9. 前記台固定ジグは、前記カセット台の周縁部の3カ所にそれぞれ設けられていることを特徴とする請求項8に記載の収納容器体。

10. (削除)

1 1. (削除)

1 2. (補正後) 請求項 2 乃至 9 のいずれかに記載の収納容器体と、
前記収納容器体が搬送され得る容器体搬送エリアと、
不活性ガス雰囲気あるいは清浄ガス雰囲気とされた被処理体搬送エリアと、
前記容器体搬送エリアと前記被処理体搬送エリアとを仕切る区画壁と、
前記区画壁に形成された開口と、

前記収納容器体の開口部が前記開口に対して前記容器体搬送エリア側で向き合うように、当該収納容器体が載置される載置台と、

前記容器体搬送エリアに設けられ、外部と連通可能なロードポートと、

前記容器体搬送エリア内に設けられ、前記収納容器体が一時的に保管され得るストックと、

前記ロードポートと前記ストックと前記載置台との間で前記収納容器体を搬送する容器体搬送機構と、

前記収容容器体が前記載置台上に載置されている時、当該収容容器体の開閉蓋を開閉する開閉機構と、

前記被処理体搬送エリア内に設けられ、前記収納容器体に収容された被処理体の大きさに対応する被処理体ポートと、

前記被処理体搬送エリア内に設けられ、前記被処理体に所定の熱処理を施すことができる処理容器と、

前記被処理体ポートを昇降させて、当該被処理体ポートを前記処理容器に対して搬入出するポート昇降機構と、

前記被処理体ポートと前記載置台上に載置された前記収納容器体との間で前記被処理体を移載する被処理体移載機構と、
を備えたことを特徴とする処理システム。